

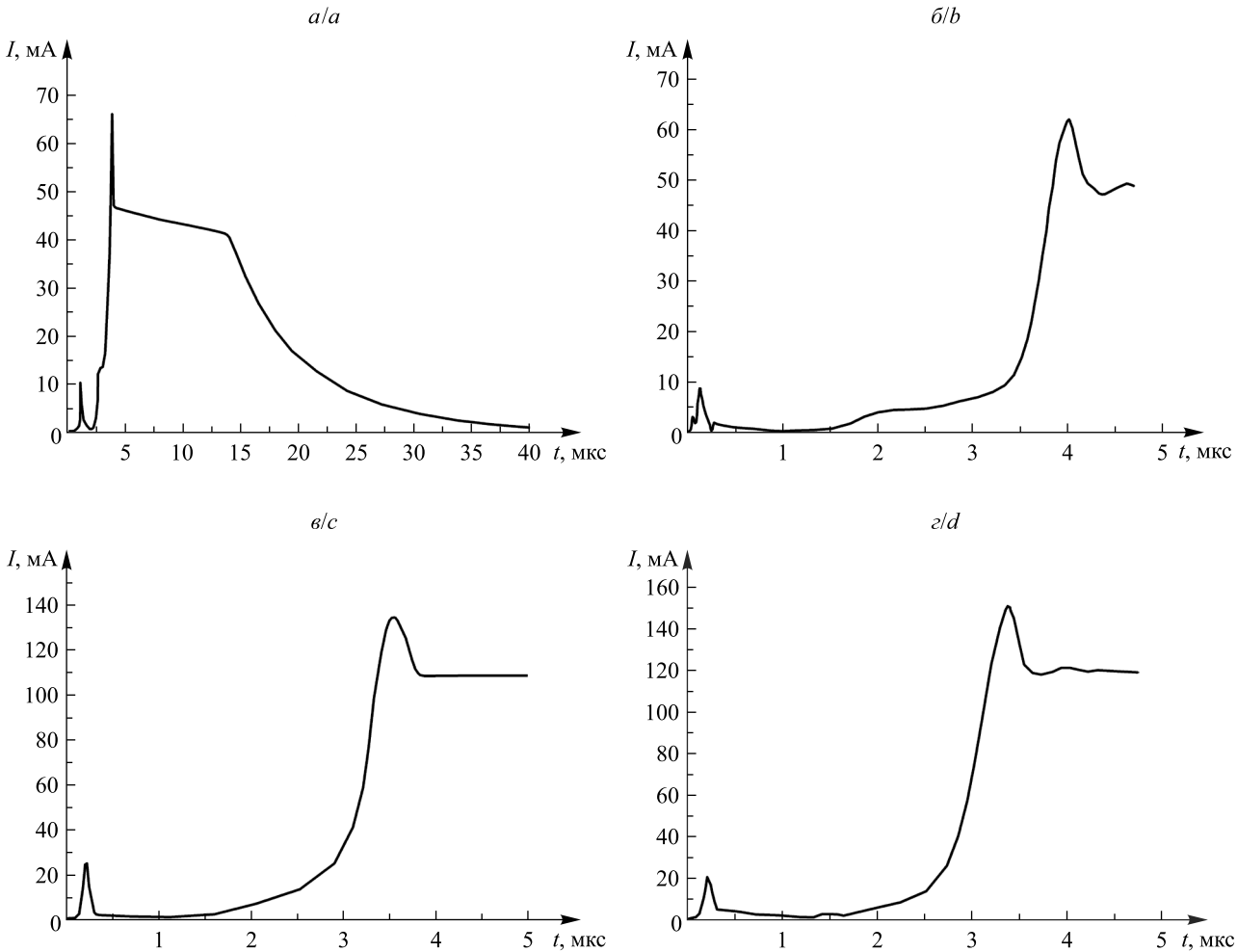


Рис. 4. Общий импульс тока и его передний фронт в промежутке сетка – подложка в режиме вторичной ионной эмиссии при различных условиях воздействия лазерного излучения на медную мишень (на участке мишень – сетка установлен постоянный потенциал $U_1 = 30$ В):

$a, б$ – плотность мощности лазерного излучения $5 \cdot 10^8$ Вт/см², $U_2 = 30$ В;

$в$ – плотность мощности лазерного излучения $5 \cdot 10^8$ Вт/см², $U_2 = 50$ В;

$г$ – плотность мощности лазерного излучения $1 \cdot 10^9$ Вт/см², $U_2 = 50$ В

Fig. 4. Total current pulse and its leading edge in the grid – substrate interval in the regime secondary ion emission at the different conditions of the acting laser radiation on a copper target (the interval target – grid have constant potential $U_1 = 30$ V): a, b – laser power density $5 \cdot 10^8$ W/cm², $U_2 = 30$ V; c – laser power density $5 \cdot 10^8$ W/cm², $U_2 = 50$ V; d – laser power density $1 \cdot 10^9$ W/cm², $U_2 = 50$ V